

自動比表面/細孔分布装置

株式会社島津製作所製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6階）



3つのポートを持ち、最大3サンプルまでを同時分析することのできる、自動ガス吸着装置です。第2ポートをジェミニ法に準拠してフリースペース測定に使用したり、第3ポートを飽和蒸気圧の連続測定に使用したりすることもできます。

装置の特長

脱ガス装置：分析目的とするサンプルの表面や細孔に吸着し汚染したガスを取り除く、ガス流通式の脱ガス処理装置

真空ポンプ：分析系との接続部位において、 20×10^{-3} mmHg以下の真空到達度が得られる、逆流防止弁を備えている、NW16仕様の吸気ポートを備えている

主な仕様

圧力測定精度：範囲（0～999mmHg） 分解能（0.05mmHg以内） 精度（フルスケールの0.5%以内）

マニホールド温度測定精度：精度（ ± 0.25 ） 分解能（0.1以内）

真空システム：真空到達度 20 μ Hg（最大） 逆流防止弁つき

運転環境：温度（10～35 運転時）（0～50 保管時） 相対湿度（20～80%）

電源仕様：電圧（85～265VAC） 周波数（50/60Hz） 所要電力（300VA 最大）

外形寸法と重量：高さ 76cm、幅 64cm、奥行き 53cm、重量 45kg